

平成28年度 第3回 フジコ・ミーティング資料

日時： 平成28年 9月29日（木） 13:00 ～ 17:00

場所： 株式会社 村田製作所 東京支社 3F 会議室
東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号

- | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1) | あ い さ つ | 13:00 ～ 13:30 | 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
副センター長 野北 寛太 |
| 2) | 講 演 | 13:30 ～ 14:00 | 「積層セラミックコンデンサの最新技術動向について」
株式会社 村田製作所
コンポーネント事業本部 第1コンデンサ事業部 商品技術部
部長 坪田 省治 氏 |
| | | 14:00 ～ 14:30 | 「三次元電子CADの可能性 - 過去・現在・未来 -」
株式会社 図研
EDA事業部 EL開発部
シニア・パートナー 松澤 浩彦 氏 |
| 3) | 参加企業自己紹介
(休憩) | 14:30 ～ 14:50
14:50 ～ 15:10 | ※村田製作所様で防災訓練が実施されることになっており、断続的に館内放送があります。ご了承ください。 |
| 4) | 研究進捗報告 | 15:10 ～ 15:40 | 「部品内蔵基板評価に関する三次元半導体研究センターの取り組み」
福岡大学 半導体実装研究所
堀内 整 |
| | | 15:40 ～ 16:10 | 「微細（直径10 μ m）TSVのCu埋め込み不良改善」
公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
八木 公輔 |
| | | 16:10 ～ 16:40 | 「センターにおけるガラスへの配線形成の取り組み」
公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
古橋 啓太 |
| 5) | 参加企業自己紹介
(続き) および
名刺交換会 | 16:40 ～ 17:00 | |

※喫煙スペース：2F（ご希望の方は、村田製作所／檜山様にお声かけくださいませ）